

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成17年6月30日(2005.6.30)

【公開番号】特開2003-236822(P2003-236822A)

【公開日】平成15年8月26日(2003.8.26)

【出願番号】特願2002-41466(P2002-41466)

【国際特許分類第7版】

B 2 8 B 11/24

C 0 4 B 28/12

C 0 4 B 28/22

C 0 4 B 40/02

【F I】

B 2 8 B 11/00 A

C 0 4 B 28/12

C 0 4 B 28/22

C 0 4 B 40/02

【手続補正書】

【提出日】平成16年10月18日(2004.10.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 8】

また、図7に示すように、間隔を空けて立接された複数本の支柱104の上に板体101を設置することも考えられる。このように板体101を点で支持すれば、線支持した場合と同様に反応むらを回避することができる。しかし、板体101を安定的に支持することが困難であるため、板体101の変形や落下を引き起こすおそれがある他、板体101の設置に手間がかかる等の問題がある。

さらに、網状の、あるいは小孔を等間隔に設けたいわゆるパンチングメタルのような平板状の支持板を設置し、この支持板上に板体を載置した状態で養生を行うことも考えられる。このようにすれば、板体の上表面および下表面から炭酸ガスの浸透をほぼ均等に行わせることができる。また、板体全体を均一な支持力で支持することができるため、線支持の場合のような板体の自重による撓みの問題も解消できる。しかし、炭酸化反応によって板体が収縮する際に、板体の下表面と支持板との間の摩擦力によって、板体下表面の収縮が板体上表面の収縮より小さくなり、反りが発生してしまうおそれがある。